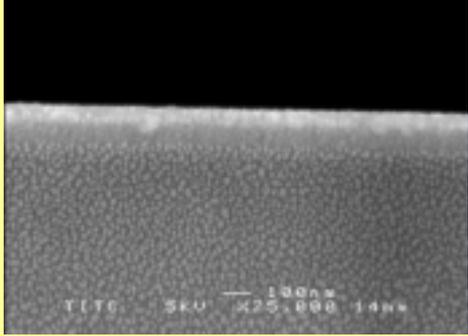


タイトル	セラミックス上に形成された金属薄膜の膜厚を調べました
事例	セラミックス成型品に形成した金属膜の抵抗が高く、その原因調査
試験内容と結果	<p>セラミックス成型品の電磁波シールド特性が悪いため、原因調査を行ったところ、金属膜の抵抗が高いことが分かった。このため、金属膜の膜質と膜厚を測るため、高分解能型電子顕微鏡による観察を行ったところ、膜質は緻密で問題ないが、電磁波シールドに必要な膜厚より薄いことが判明した。</p>  <p>(試験内容を分かりやすく説明するために、創作しています)</p>
使用した装置	高分解能走査型電子顕微鏡 (FE-SEM) (JSM6300F; 日本電子製)
手数料 (平成21年)	・電子顕微鏡による観察 4,610円 (1試料) ・追加観察 1,120円 (1視野)
担当部署	機械電子研究所 電子技術課 076-433-5466